

UHR-CFE-SEM TE-Driver 及離子切割拋磨機之影像與元素分析發表會

Image of UHR CFE-SEM with TE detector、IM4000PLUS and EDS Demonstration

主 題：「**真實樣品 vs.完美解析**」日立 SU8220 冷場放式 FESEM，使用 mild-flash system 除了維持 cold-FEG 超高亮度與空間散射小的特性，更可讓電流穩定且提升，搭配 TE device (Aperture For Bright/Dark Field STEM / STEM Holder) 可以同時同地觀測 SEM+TEM-BF+TEM-DF 影像。當然，沒有理想的樣品，就無法觀察到真實的結果。日立 IM4000 PLUS 提供高速且無應力的 Ar 離子切割機，切割精度誤差在 $\pm 2\mu\text{m}$ ，且可搭載冷凍控溫與空氣阻斷等功能，提供清楚的斷面分析。即使是溫度敏感或是及易氧化的樣品都可以克服。Bruker FQ5060 平插式的 EDS，其超大的 Solid angle 是一般斜插式 EDS 的數十倍，除了提供快速的 mapping 分析，更是唯一能分析表面落差甚至孔洞內部成分的 EDS。會議中將詳細介紹真實樣品製作與各式影像偵測特性，讓解析臻至完美！

參加對象：各表面分析實驗室、研發及製程等相關人員

主辦單位：Hitachi High-Technologies/益弘儀器股份有限公司

協辦單位：Bruker Corporation (新加坡)

國立台灣大學理學院貴重儀器中心

時間地點：106/10/19 台灣大學理學院思亮館國際會議廳

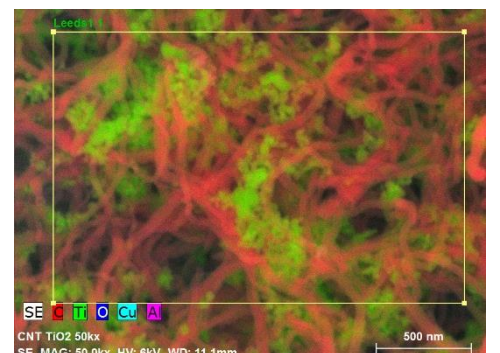
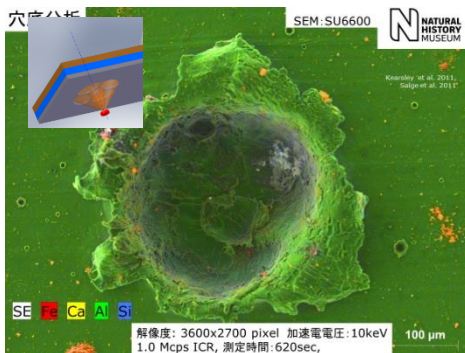
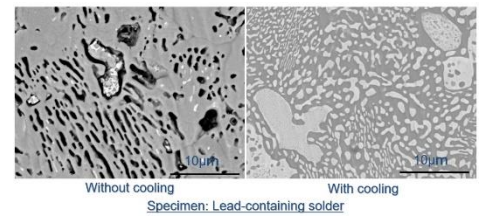
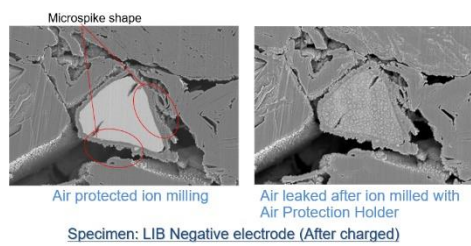
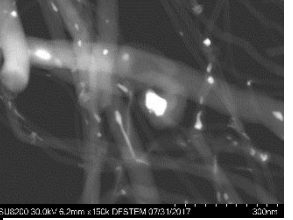
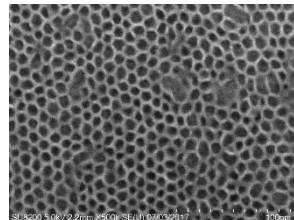
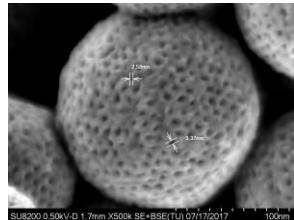
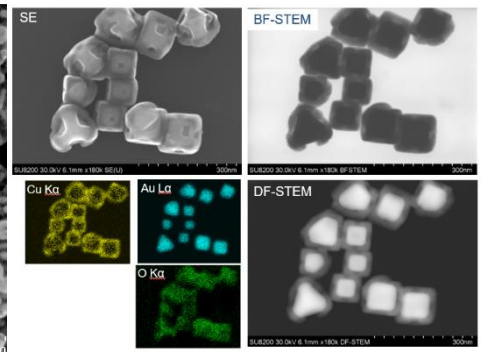
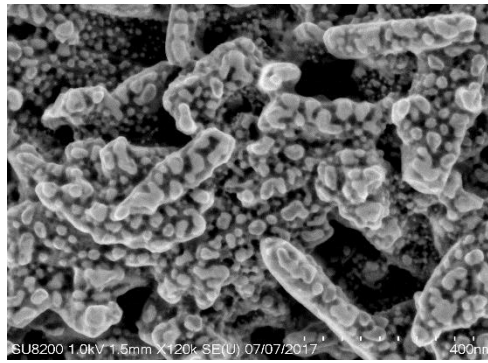
講 師：日立那珂實驗室 應用技術中心 竹內秀一

益弘電顯部 應用中心 陳柏智 郭瀚介

布魯克新加坡 應用部區經理 王銳

樣品 DEMO：10/19 14:00– 17:00; 10/20 9:30– 11:00; 申請 DEMO 辦法：請上 google 報名表申請填寫。

時 間	流 程	介 紹 人
09:10 – 09:30	報 到	
09:30 – 09:40	開場致辭	周必泰教授 (台灣大學-化學系) 主辦單位
09:40 – 10:30	HITACHI SU8220 UHR FESEM with TE device 機台特性及影像解析應用	竹內秀一 (HHT) 陳柏智 應用工程師 (益弘)
10:30 – 11:10	HITACHI IM4000 plus ION MILLING SYSTEM with Air protection system & UV Ozone 在樣品製作上的優勢及應用	陳柏智 應用工程師 (益弘) 郭瀚介 應用工程師 (益弘)
11:10 – 11:30	TEA TIME	
11:30 – 12:20	Bruker FQ5060 在輕元素超低電壓分析上的表 現與孔洞材料分析應用	王銳 區經理 (BRUKER)



報名方式：以 [google 報名表](#) 申請為主
 ※確認報名成功專線：台北(02)27552266#310 Kelly

超高解析冷槍場放射掃描式電子顯微鏡解析應用研討會 報名表

e-mail: kelly@ehong.com.tw			
我要報名參加 <input type="checkbox"/> 10/19			
單位		電話	
姓名		e-mail	

校總區 Taipei Main Campus

復興南路二段
Sec. 2, Fuxing S. Rd.

辛亥路二段 Sec. 2, Xinhai Rd.



益弘儀器股份有限公司

『超高解析冷槍場放射掃描式電子顯微鏡解析應用研討會』

106 台北市大安區復興南路二段 157 號 2 樓

研討會邀請函

TO: